

会議報告(1)

第6回表面科学基礎講座

——表面分析の基礎と応用——

御園生 誠

東京大学工学部 〒113 東京都文京区本郷 7-3-1  
(1987年9月21日受理)

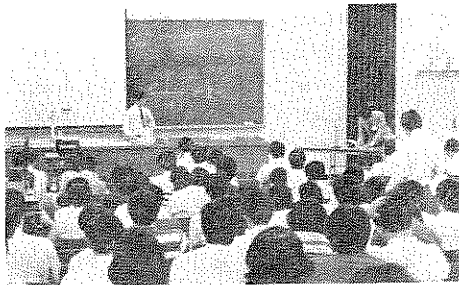
The 6th Surface Science Lecture Course

Makoto MISONOO

Faculty of Engineering, The University of Tokyo  
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113

(Received September 21, 1987)

第6回表面科学基礎講座は、昨年(昭和62年)の第5回と同じ「表面分析の基礎と応用」を主題として昭和62年5月20日(水)から5月22日(金)までの3日間、東京大学理学部化学教室講堂をお借りして開催された。受講者は前回と同じ180余名と盛況であった(写真参照)。世間で不



況も噂されており受講者数が減るのではと心配していたが、早目に準備をすすめ宣伝したこと、本講座の狙いが時宜を得たもので昨年あたりからは評価が定着してきたことなどにより多くの参加が得られたものと思われる。

参加者のおよその内訳は、大学、研究所関係が十数名で他は企業関係者である。後者の中では化学(繊維、窯業を含む)が78名、電気、通信59名、機械、建設16名が主なものである。

プログラムは下表に示したとおりで、好評であった第5回のもを基本的には踏襲している。若干変更した点は、初日を「表面分析の基礎」と題して総論と真空などの基礎技術や将来展望にあて表面分析全体を見渡した入門編としたことである。幸い良い講師に恵まれ大変好評であった。2日目は代表的な表面分析法であるAES, XPS, SIMSについてのベテラン講師による講義であった。各分析法の実験的比較論に至るまで先生方には奮闘して頂いた。最終日も経験豊かな講師による多くの実例をまじえた解説で、最後まで受講者は減ることがなかった。

講師の先生方には、テキストの作成から講演、討論に至るまで、ご熱心にご協力頂いた。改めて感謝の意を表したい。また、今回は会場の確保に若干の手違いがあったが、幸い岩澤理事(東大理)のご厚意により良い会場が確保でき大過なく成功裡に講座を終えることができた。その他ご協力頂いた各位に厚く御礼申し上げたい。

なおテキストは本講座用に特別に作成されたもので、内容は極めて充実している。若干残部があるので入手御希望の方は、本会事務所に連絡願いたい。

月 日	講 義 題 目	講 師
5月20日(水) 表面分析の基礎	表面分析で何がどこまで解るか 表面分析になぜ真空は必要か 表面構造をどのようにして決めるか 表面分析 Today & Tomorrow 総合討論	最上 明矩(日本電子) 山川 洋幸(日本真空技術) 井野 正三(東大理) 市ノ川竹男(早大理工) 市ノ川竹男(早大理工)
5月21日(木) 最表面の分析	オージェ電子分光法(AES/SAM) 光電子分光法(ESCA) 二次イオン分析法(SIMS) 総合討論	吉原 一紘(金材技研) 福田 安生(日本鋼管) 角山 浩三(川崎製鉄) 御園生 誠(東大工)
5月22日(金) 表層の分析	電子線マイクロアナライザ(EPMA) 電子顕微鏡(TEM/SEM) 赤外分光(FT-IR), ラマン分光 総合討論	副島 啓義(島津製作所) 坂東 義雄(無機材研) 錦田 晃一(パーキンエルマー・ジャパン) 坂田 亮(慶大理工)